

МЕТОД НЕРУЙНІВНОЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ЗА ГЛИБИНОЮ ПОШАРОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕФЕКТІВ СТРУКТУРИ



Прилад для неруйнівної діагностики монокристалів із дефектами декількох типів

Призначення

Наукове приладобудування, наноіндустрія, мікроелектроніка

Характеристики

Чутливість до дефектів (за концентрацією або об'ємною часткою) – 10^{-8} – 10^{-6}

Переваги

Діагностика без руйнування об'єкта:
з підвищенням чутливості до недосконалостей структури на 4–6 порядків величини;
з можливістю одночасного визначення багатьох структурних параметрів;
з можливістю визначення структури пошарово з нанорозмірним кроком;
з визначенням змін структури унаслідок швидкоплинних процесів;
з суттєвим спрощенням методик

Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL3, TRL3
Продаж патенту за ліцензійною угодою

Охорона інтелектуальної власності

IPR2

Контактна інформація

Бевз Віталій Петрович, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
+38 044 424 12 05; e-mail: BevzV@ukr.net